

**FUNKCIONALNA INTEGRACIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU**

**PMF-ST, PF-ST TE KTF-ST**

**KROZ RAZVOJ ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE  
INFRASTRUKTURE U ZGRADI TRI FAKULTETA**

**KATALOG  
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE OPREME**

## Transmisijski elektronski mikroskop (TEM)

Kat. broj: 121.77.103

### Namjena:

JEOL JEM 1400 Flash je 120 kV TEM-transmisijski elektronski mikroskop s visokim kontrastom i velikom svjetlinom te s integriranim visokokvalitetnim sCMOS sustavom kamere visoke razlučivosti. JEM 1400 Flash mikroskop može koristiti i LaB<sub>6</sub> katode i W katode, bez dodatnih hardver promjena na mikroskopu te ima razlučivost: point resolution - 0,38nm, lattice resolution - 0,2 nm. Postolje za uzorke je potpuno motorizirano u x, y i z smjeru pomaka.

+

- Dijamantni nož 2 mm 45°
- Ultramikrotom RMC Boeckeler s kontrolerom PT XL75498 – POWERTOME – sa snažnom ručicom za rezanje uzorka (power driven cutting stroke), koja ne posustaje kod tvrđeg uzorka ili velikog bloka uzorka.

### Kratki opis metode:

Pri promatranju bioloških uzorka, makro-molekularnih materijale, lijekova, patoloških i histoloških prereza i virusa, obično se prvo potvrđuje cjelokupni prikaz tkiva, struktura, ciljnih mjesta i područja promatranja pri malom povećanju, a zatim se pažljivo proučavaju fine strukture od interesa na velikim povećanjima.



Model: **JEOL JEM 1400 Flash**

### Tehničke značajke:

- Raspon napona od 10-120kV
- W i LaB<sub>6</sub> katoda
- Razlučivost „point resolution“ 0,38 nm
- Razlučivost „lattice resolution“ 0,2 nm
- Max. povećanje uređaja: 1 200 000 puta
- Min. povećanje bez digitalne obrade slike: 10 puta
- Goniometar s max. motoriziranim nagibom (eng. specimen tilt angle) od ± 70°
- Pretkomora za uzorke (eng. airlock) s vakuumskim ispumpavanjem do visokog vakuma (sekundaran vakuum) za zaštitu od onečišćenja uzorka u pretkomori
- Standardni nosač za unos uzorka/mrežice u mikroskop
- Višestruki nosač za unos četiri (4) uzorka/mrežice
- Automatski podizač izvora elektrona (eng. automatic gun lift) za izmjenu filimenta i funkciju „bake out“ tj. pregrijavanje kolone za poboljšanje vakuma i zaštitu od kontaminacije na uzorku

- Raspon motoriziranih pomaka postolja: X od -1 mm do +1 mm, Y od -1 mm do +1 mm, Z od -0.5 mm do +0.5 m
- Integrirana CMOS kamera s mogućnošću promatranja od min. 10 puta do min. 1.000.000 puta te mogućnošću „frame rate“ promatranja od min. 25 fps pri razlučivosti od min. 2048 x 2048 piksela
- Mogućnost promatranja slike pomoću kamere i fluorescentnog ekrana
- Snop slabijeg intenziteta za osjetljive uzorke (eng. low dose beam)
- Cryo antikontaminacijski uređaj LNT (eng. Liquid Nitrogen Tank) kompatibilan s EDS spektrometrom s mogućnošću istovremene upotrebe
- Sustav za usporednu svjetlosnu i elektronsku mikroskopiju, CLEM (Correlative Light Electron Microscopy) - pri niskim povećanjima mikroskop može prikazati cijelu površinu mrežice s promjerom od 2 mm na kameri

Primjena u industriji:

- Biologija (zoologija, botanika, stanična biologija, histologija, virologija, mikrobiologija)
- Farmacija
- Medicina (histologija, citologija, patologija, mikrobiologija...)
- Nanotehnologija,
- Industrija polimera i naprednih materijala
- Rudarstvo

Dodatne informacije

- [JEOL JEM 1400 Flash – mrežna stranica](#)

## Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM)

Kat. broj: 121.77.101

### Namjena:

JEL JSM 7610F Plus je pretražni elektronski mikroskop (SEM - scanning electron microscope) s izvorom elektrona koji zbog narinutog električnog polja ima pojačanu emisiju elektrona (FEG - field emission gun). Smještaj izvora elektrona unutar elektronske leće omogućava stabilan snop elektrona te dobivanje slika visoke razlučivosti za vrlo široki raspon struja (od nekoliko fA do nekoliko stotina pA). Položaj objektiva unutar kolone te mogućnost primjene negativnog napona na uzorak (Gentle Beam®) povećavaju razlučivost i pri vrlo niskim naponima ubrzanja.

Uz mikroskop, instalirani su i sljedeći instrumenti:

- EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) spektrometar (Oxford Instruments AZtec Live ADVanced UltimMax 65), za elementalnu analizu uzorka
- Sustav za raspršivanje tankih slojeva vodiča (Quorum (model Q150T ES Plus)), omogućava oslikavanje i površina električnih izolatora
- Instrument za poprečno rezanje i fino poliranje uzorka (JEOL IB-19530CP Cross Section Polisher), omogućava snimanje poprečnog presjeka uzorka.

### Kratki opis metode:

Pretražna elektronska mikroskopija standardna je metoda oslikavanja površina uzorka s razlučivošću do 1 nm. Nužan preduvjet oslikavanja je da ispitivana površina bude vodič; inače, zbog nabijanja površine elektronima iz snopa (te poslijedno nekontroliranog i nasumičnog stvaranja lokalnog električnog polja na površini) dobivena slika postaje zamućena.

Elektroni emitirani iz izvora elektrona ubrzavaju se i usmjeravaju na uzorak, pri čemu se površina uzorka pretražuje (skenira) liniju po liniju. U kontaktu s uzorkom, elektroni iz snopa se, među ostalim, elastično rasprše (čime dobijemo BEI-slike, *back-scattered electron imaging*), izbiju elektrone iz atoma uzorka čijim bilježenjem dobijemo SEI-slike (*secondary electron imaging*) ili potaknu atome iz uzorka na emisiju fotona, čije je energetski spektar u području rendgenskih zraka (EDS, *energy dispersive X-ray spectroscopy*) karakterističan za pojedine elemente. Analiza dobivenih EDS-spektara daje nam mogućnost analize prisutnih elemenata na površini uzorka.



Model: **JEOL JSM 7610F**

Tehničke značajke:

- Razlučivost pri naponu ubrzanja elektrona: 1,0 nm (pri 1 kV), 0,8 nm (15 kV)
- Opseg povećanja: od 25× do 1.000.000×
- Napon ubrzanja elektrona: od 100 V do 30 kV
- Gentle Beam® – mogućnost nametanja negativnog napona na uzorak s ciljem usporenja elektronskog snopa, što rezultira boljom rezolucijom te manjim efektom nabijanja uzorka
- Sustav elektronskih leća smještan je unutar kolone, s ugrađenim filtrom (*r-filter*) za razdvajanje upadnih elastično raspršenih i sekundarnih elektrona
- U komori za uzorce se nalaze detektori sekundarnih (SEI) i elastično raspršenih (BEI) elektrona
- Automatsko određivanje fokusa (AF) te kontrasta i svjetline (ACB) te anuliranje astigmatizma (AS)
- Struja elektronskog snopa: od 1 pA, 100 nA (pri naponu ubrzanja od 10 kV), 200 nA (15 kV) do 400nA (30 kV)
- Pretkomora (*load lock*) za brzu zamjenu uzorka
- Ugrađena CCD-kamera u boji za brzo pronalaženje detalja na uzorku
- Računalno upravljanje mikroskopom

Primjena u industriji:

Analiza površina i kemijskog sastava materijala, određivanje veličine i strukture čestica do razlučivosti od 1 nm. Primjena u:

- Industriji metala, poluvodiča i izolatora
- Mikroelektronici
- Mikro i nanotehnologiji
- Medicini i
- Farmaciji

Dodatne informacije

- [JSM 7610F Plus – mrežna stranica](#)



**Sveučilište u Splitu,**  
Ulica Ruđera Boškovića 31  
21000 Split  
+385 21 558 212  
[rektorat@unist.hr](mailto:rektorat@unist.hr)  
<https://www.unist.hr/>



Funkcionalna integracija  
SVEUČILIŠTA U SPLITU



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo regionalnoga  
razvoja i fondova Europske unije



KTF  
SVEUČILIŠTE U SPLITU  
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj